

# 多点監視用パーティクルセンサ KA-02

センサ多点モニタリングシステムの構築に最適



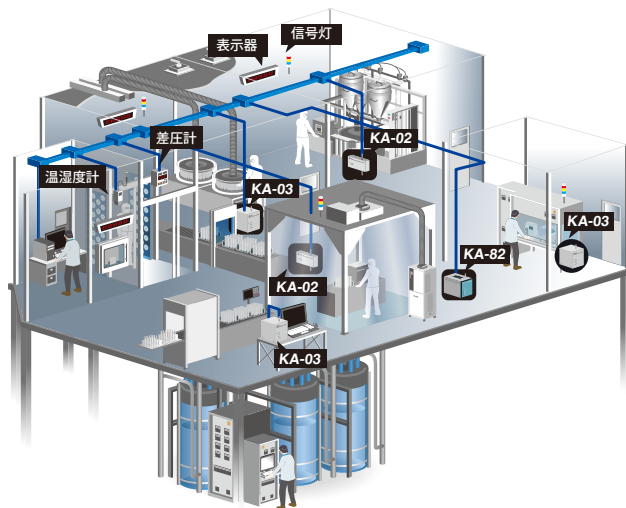
- 小型・軽量のため、プロセス装置内の発塵モニタに
- 粒径区分(2段階)0.3  $\mu\text{m}$ 、0.5  $\mu\text{m}$ 以上
- 筐体にステンレスを採用し、耐薬品性を向上
- 多点モニタリングシステムに対応(RPモニタ Evo10 K1701 Ver. 3)

## 仕様 [KA-02]

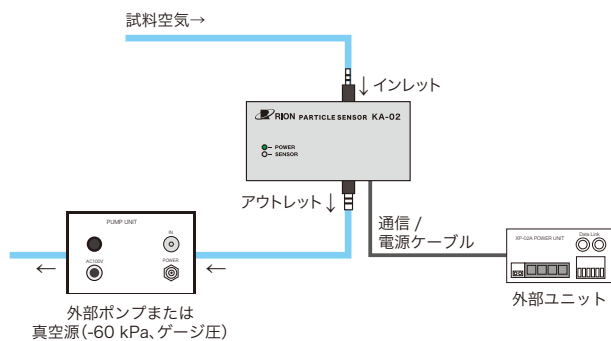
光学方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー(波長780 nm、定格出力35 mW)
レーザー製品のクラス	クラス1 IEC 60825-1
受光素子	フォトダイオード
定格試料流量	2.83 L/min
粒径区分(2段階)	0.3 μm以上、0.5 μm以上
最大粒子個数濃度	140 000 000個/m <sup>3</sup> (計数損失10%以内)
表示ランプ	POWER、SENSOR
接続口	
インレット	外径1/8インチ(約3.18 mm)
アウトレット	外径1/4インチ(約6.35 mm)
入出力端子	
RJ-45	多点モニタリングシステム、警報出力(TTL出力)
使用温湿度範囲	10~40℃、85%RH以下(結露のないこと)
電源	DC9~28V(外部ユニットから供給、オプション)
大きさ・重さ	52(H)×107(W)×53(D)mm(突起部を除く)・約360g
付属品	面ファスナー、簡易取扱説明書
オプション	粒径改造、ISO 21501-4(JIS B 9921)対応(受注生産)

\* 本器には、電源、ポンプ、表示器は搭載されていません。

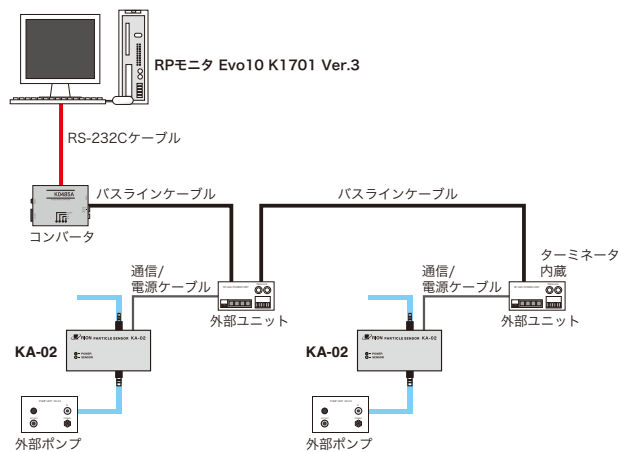
## センサ多点モニタリングシステム 構成例



## 基本的な構成



## センサ多点モニタリングシステム 接続例 (RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3の場合)

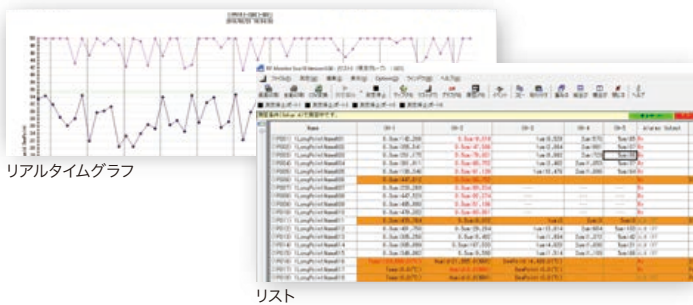


## RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3

オプション



- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が行えます。
- シリアルモードのパーティクルカウンタと、MultiモードRのパーティクルカウンタを最大32台(拡張160台接続)まで同時に制御可能
- 対応OS: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit / 11 Pro 64 bit



**リオン株式会社** <https://www.rion.co.jp/>

\*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。  
\*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

### 製品の販売に関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 営業部  
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7445

九州リオン(株)  
〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号  
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

### メンテナンスに関するお問い合わせ

本社 微粒子計測器事業部 サービス窓口  
〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号  
TEL(042)359-7835 FAX(042)359-7445